#### (公財) 日本板硝子材料工学助成会

第42回無機材料に関する最近の研究成果発表会

- 材料研究に新しい風を- 2025年1月22日@住友会館(東京)

# エピタキシャル5d酸化物薄膜創製に基づく 電流-スピン流変換現象に関する研究





# ✓ イントロダクション - page 1~7 (スピントロニクスについて、電流-スピン流変換、なぜ酸化物?)

- ✓ 5dイリジウム酸化物を用いたスピン流生成とエピタキシャル界面の影響 page 8~17
- ✓ 5dタングステン酸化物を用いたスピン流生成の開拓 page 19~22

✓ まとめと展望 - page 23

スピントロニクスとは?



1/23

スピンに起因した物理現象の探求。見出した物性・機能をデバイスに応用
 電子デバイスの高性能化:不揮発性の省電力磁気メモリ開発など

解決

近年の社会的な問題:コンピュータにおける膨大な電力消費 (情報化社会の発展に伴う人工知能やモノのインターネットの普及)

# スピントロニクス研究の起爆剤:巨大磁気抵抗効果

GMR (Giant Magnetoresistance): 磁化が平行と反平行状態で電気抵抗が大きく変化



Baibich *et al*., Phys. Rev. Lett. (1988). Binash *et al*., Phy. Rev. B (1989). (スピン依存伝導)

- ✓ 金属多層膜(人工格子)
- ✔ 磁性層と非磁性層が交互に積層

2/23

✓ 各層は厚さ~数nm程

# スピントロニクス研究の起爆剤:巨大磁気抵抗効果

#### **GMR** (Giant Magnetoresistance)



#### 電流-スピン流変換

4/23



。 電子のスピン角運動量の流れ

· 電流Jと異なり、発熱を抑制

→ デバイスの省電力化に貢献



- 強いスピン-軌道相互作用を有する
  非磁性体において電子スピンが散乱
- スピンホール角*θ*<sub>SH</sub> (~*J*<sub>s</sub>/*J*<sub>c</sub>) が指標

磁性層と非磁性層の界面を持つ二層膜デバイスが舞台

## ニ層膜構造を用いた電流-スピン流変換

5/23



Pt/Co, Ta/CoFeB, W/CoFeB...

Miron et al., Nature (2011).

Liu et al., Science (2012).

Pai et al., Appl. Phys. Lett. (2012).

磁化制御の更なる効率化には 電流−スピン流変換効率の増大が必須

### 界面品質がもたらす電流-スピン流変換効率への影響



 $T \sim 20 - 40\%$ :

金属二層膜CoFeB/Pt, Co/Pt…

新たな二層膜構造及びスピン流生成物質 の探索が必須

## 5d電子系酸化物を用いたスピントロニクス

7/23

E

6s



を持つ50電子のみが電気伝導を支配

スピントロニクス研究への利点

◦エピタキシャル成長 (基板の配向面に沿う成長)◦結晶対称性・界面の制御

酸化物薄膜成長 & スピントロニクスの融合

本日:5d酸化物 (SrIrO3 & WO2)を用いた電流-スピン流変換

# 5d電子系イリジウム酸化物SrlrO<sub>3</sub>

。ペロブスカイト構造 ABO<sub>3</sub>

- ・バルクでは高圧安定相
  → 歪み効果により(応力)、エピタキシャル膜
  では常圧化において安定
- 。非磁性 & 半金属

スピンホール効果に起因したスピン流生成

#### どのように薄膜合成するのか?





## パルスレーザー堆積法を用いた薄膜合成



SrIrO<sub>3</sub>焼結ターゲットの作製



° IrO<sub>2</sub> + SrCO<sub>3</sub> → SrIrO<sub>3</sub> + CO<sub>2</sub><math>° 放電プラズマ焼結法

パルスレーザー堆積法



# エピタキシャルSrlrO<sub>3</sub>の薄膜作製と結晶性評価



10/23

#### 高品質なエピタキシャルSIO薄膜が作製

Hori, <u>Ueda</u> et al., Appl. Phys. Lett. (2022).

二層膜の準備とデバイス作製

<sup>。</sup>マグネトロンスパッタ法 – 強磁性金属Co<sub>20</sub>Fe<sub>60</sub>B<sub>20</sub>, 保護層Ta

。フォトリトグラフィー&Arミリング → ホールバー型デバイス



<u>50 μm</u>

光学顕微鏡図

#### 四端子抵抗*R*測定:電気抵抗率 $\rho$ ~ 190 $\mu\Omega$ cm (CoFeB) $\rho$ ~ 570 $\mu\Omega$ cm (SIO)

### スピン流生成の観測:高調波ホール測定



### スピン流生成の評価:高調波ホール測定結果の解析



13/23

Hori, <u>Ueda</u> et al., Appl. Phys. Lett. (2022).

エピタキシャルSrlrO<sub>3</sub>における電流-スピン流変換

二層膜デバイス:CoFeB(*t* nm)/SrIrO<sub>3</sub>(20 nm)



✔ CoFeB膜厚に依存しない → SIO由来のスピン流生成 (スピンホール効果) ✔ 実績のあるPtの3倍

14/23

→ 有力なスピン流生成物質

酸化物エピタキシャル界面を用いた 電流-スピン流変換の研究に期待

Hori, <u>Ueda</u> et al., Appl. Phys. Lett. (2022).

。ペロブスカイト構造

- 室温下において強磁性を発現
  (組成に依存)
- SrIrO<sub>3</sub>との格子整合性が良好

格子欠陥の少ない理想的な界面が実現

→ *T*の増強が期待 → *ξ*<sub>□</sub>も増大

 $\xi_{\rm DL} = \boldsymbol{T} \theta_{\rm SH}$ 

*T~*20 - 40%:金属二層膜CoFeB/Pt, Co/Pt…



# エピタキシャル酸化物ニ層膜の作製と結晶性評価

二層膜: SIO(15 nm)/(La<sub>0.7</sub>, Ba<sub>0.3</sub>)MnO<sub>3</sub>(20 nm)



# 新たなスピントロニクス材料の探索

他の5*d*酸化物:バンド絶縁体(5*d*<sup>0</sup>)が安定価数

→ 価数制御により金属相が得られる系を探す

二元系タングステンW酸化物 WO<sub>2</sub>



# WO<sub>2</sub>の結晶構造、薄膜作製と結晶性評価



歪んだルチル構造

反応性スパッタ法: Ar: O<sub>2</sub>比& 電力 (W)制御



Ueda et al., APL Mater. (2023).

# 電気抵抗率と電子状態の評価

21/23



Jones et al Sur. Sci. (1997).

金属相 $WO_2(5d^2)$ の確認

<u>Ueda</u> et al., APL Mater. (2023).

# WO2の電流-スピン流変換効率

22/23

二層膜デバイス:強磁性金属Ni<sub>80</sub>Fe<sub>20</sub>(3 nm)/WO<sub>2</sub>(20 nm)



エピタキシャルWO<sub>2</sub>は有力なスピントロニクス材料

<u>Ueda</u> et al., APL Mater. (2023).



23/23

#### 酸化物薄膜創成を軸とする電流-スピン流変換に関する研究

· 高効率電流-スピン流変換デバイスの創出 · 新規なスピン流生成物質を開拓

スピントロニクス研究における酸化物薄膜の有用性を示す成果

#### 展望

酸化物界面のスピン物性を解明 & 電流-スピン流変換効率の制御指針を獲得 磁気デバイスにおける基盤技術の更なる発展に貢献

謝辞:日本板硝子材料工学助成会からの支援に心から感謝します.